

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和1年11月7日(2019.11.7)

【公開番号】特開2019-57530(P2019-57530A)

【公開日】平成31年4月11日(2019.4.11)

【年通号数】公開・登録公報2019-014

【出願番号】特願2017-179330(P2017-179330)

【国際特許分類】

H 01 L 21/205 (2006.01)

H 01 L 21/31 (2006.01)

C 23 C 16/44 (2006.01)

C 23 C 14/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/205

H 01 L 21/31 B

C 23 C 16/44 J

C 23 C 14/00 B

【手続補正書】

【提出日】令和1年9月19日(2019.9.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

排出ガスが排出されるプロセス室と、

前記排出ガスの一部を含む排液を排出する排液部と、

前記プロセス室と前記排液部との間に設けられ、前記排出ガスの移動方向に対して垂直方向の断面において第1の開口面積を有する第1の配管と、

前記第1の配管と前記排液部との間に設けられ、前記排出ガスの移動方向に対して垂直方向の断面において前記第1の開口面積より小さい第2の開口面積を有する第2の配管と、

前記第1の配管に接続され、前記第1の配管に標準沸点が25以上の凝縮剤を供給する第3の配管と、

を備える半導体装置又は液晶装置の製造装置。

【請求項2】

前記第1の配管の中の温度調整を行う温度調整部を、更に備える請求項1記載の製造装置。

【請求項3】

前記凝縮剤を前記第1の配管に供給する前に加熱する加熱部を、更に備える請求項1又は請求項2記載の製造装置。

【請求項4】

前記第2の配管と前記排液部との間に設けられ、前記排出ガスの移動方向に対向した面を有する部材を、更に備える請求項1ないし請求項3いずれか一項記載の製造装置。

【請求項5】

排出ガスが排出されるプロセス室と、

前記排出ガスの一部を含む排液を排出する排液部と、

前記排出ガスの残部を外部に排出する排出部と、

前記プロセス室と前記排液部との間に設けられ、前記排出ガスの移動方向に対して垂直方向の断面において第1の開口面積を有する第1の配管と、

前記第1の配管と前記排液部との間に設けられ、前記排出ガスの移動方向に対して垂直方向の断面において前記第1の開口面積より小さい第2の開口面積を有する第2の配管と、

前記プロセス室と前記第1の配管との間に設けられ、前記プロセス室の中の圧力を制御する第1の圧力調整部と、

前記排液部と前記排出部との間に設けられ、前記第1の配管の中の圧力を制御する第2の圧力調整部と、

を備える半導体装置又は液晶装置の製造装置。

【請求項6】

前記第1の配管の中を冷却する冷却部を、更に備える請求項5記載の製造装置。

【請求項7】

前記第2の配管と前記排液部との間に設けられ、前記排出ガスの移動方向に対向した面を有する部材を、更に備える請求項5又は請求項6記載の製造装置。

【請求項8】

排出ガスの移動方向に対して垂直方向の断面において第1の開口面積を有するスプレー塔と、前記スプレー塔の中に設けられ液体を噴出するスプレーノズルと、前記排出ガスの一部を含む排液を貯留する排液部と、前記スプレーノズルと前記排液部との間に設けられ、前記第1の開口面積より小さい第2の開口面積を有する絞りと、
を備える排出ガス処理装置。

【請求項9】

前記絞りと前記排液部との間に設けられ、前記排出ガスの移動方向に対向した面を有する部材を、更に備える請求項8記載の排出ガス処理装置。